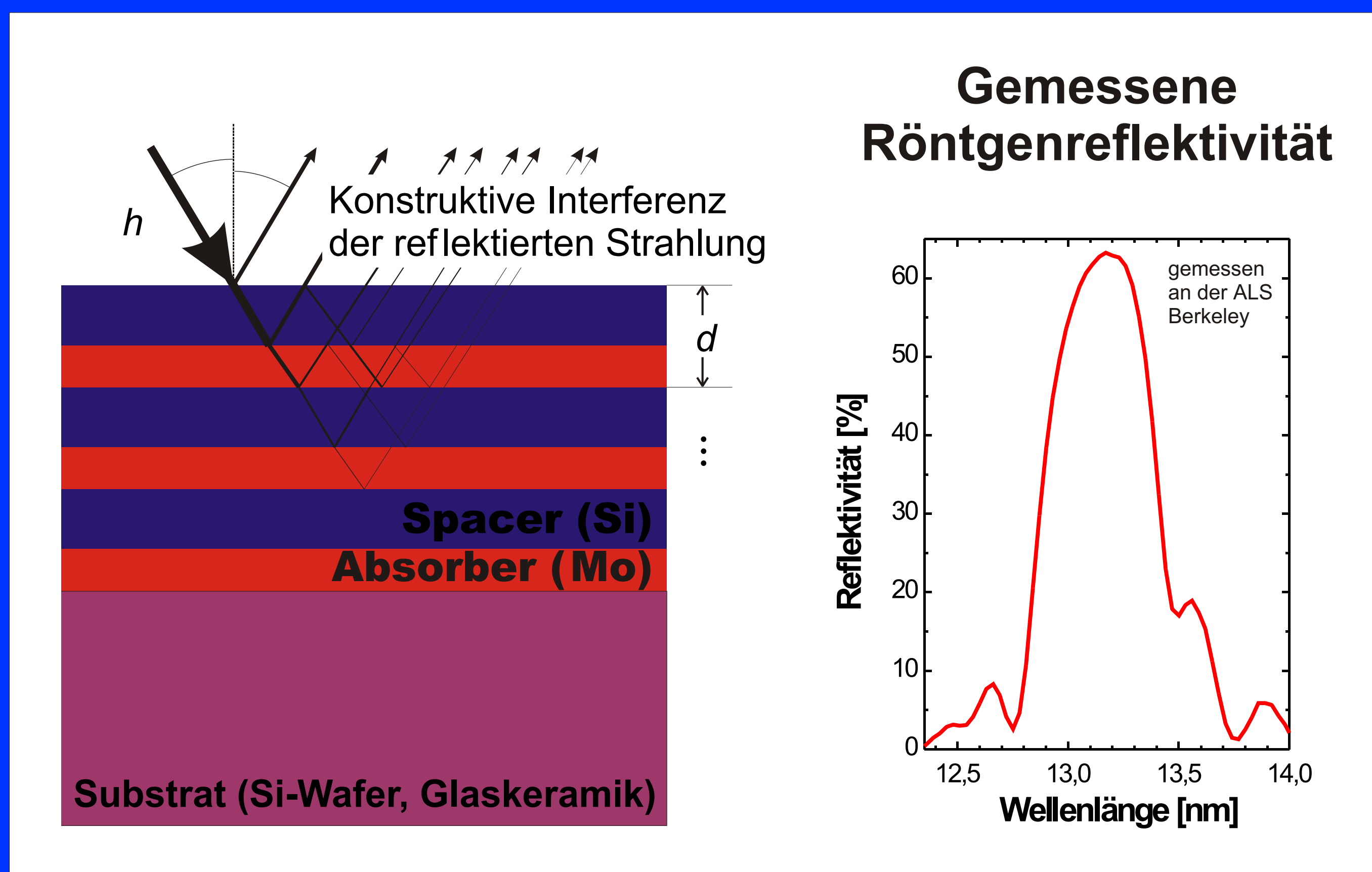
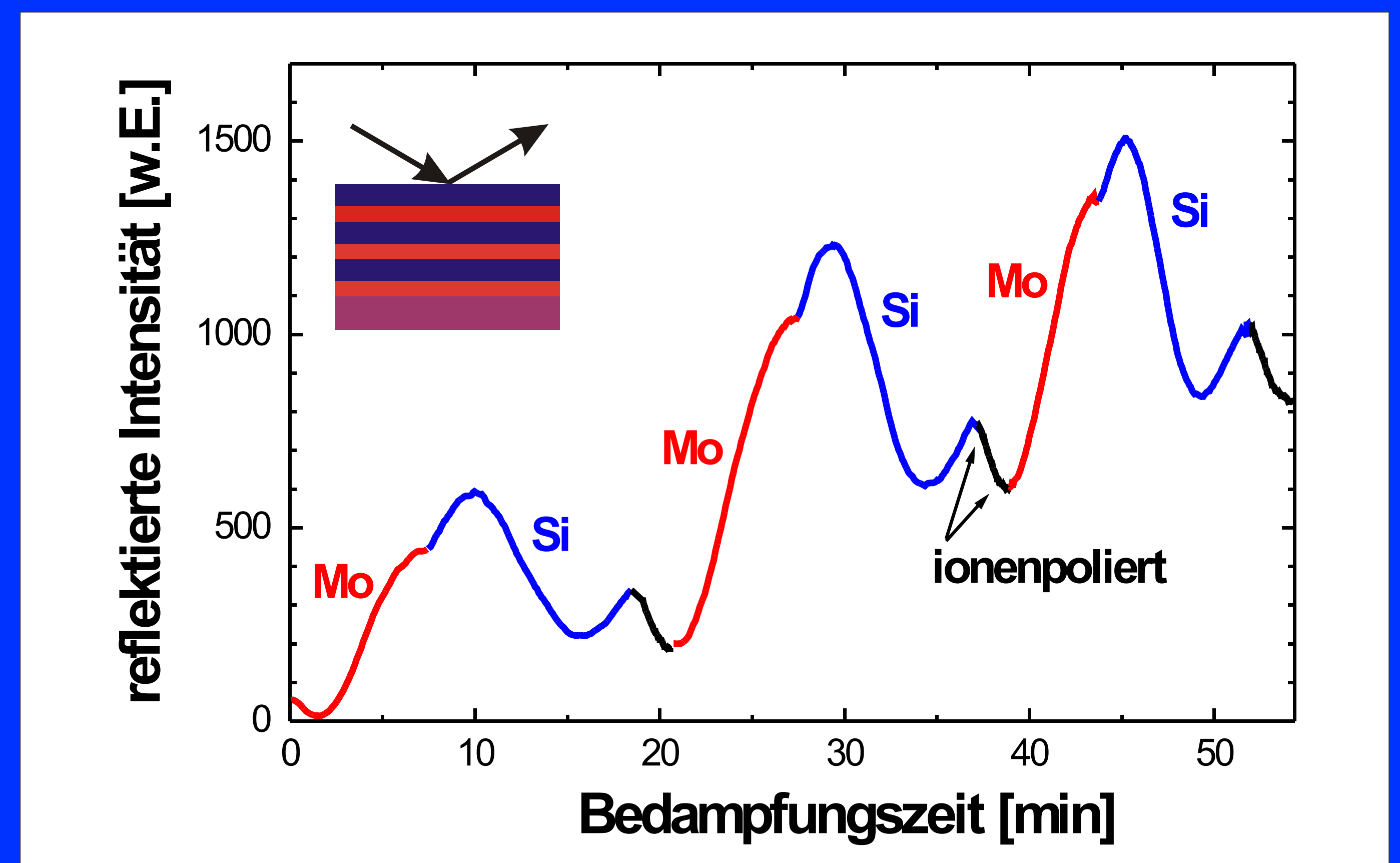


# Röntgenoptische Komponenten für EUVL, Nanotechnologie und Synchrotronstrahlungsforschung

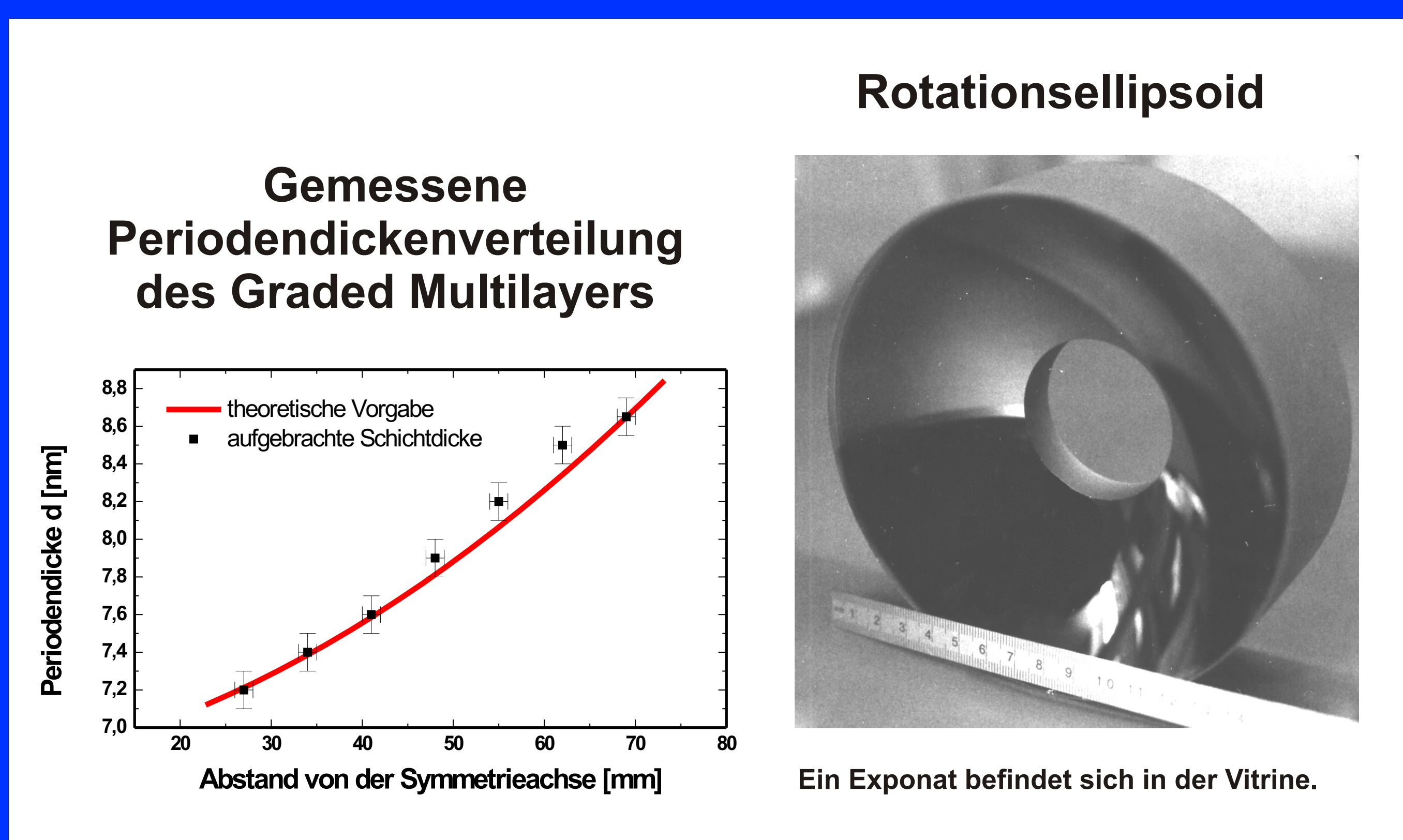
## Funktionsprinzip eines Multilayers als Röntgen Spiegel



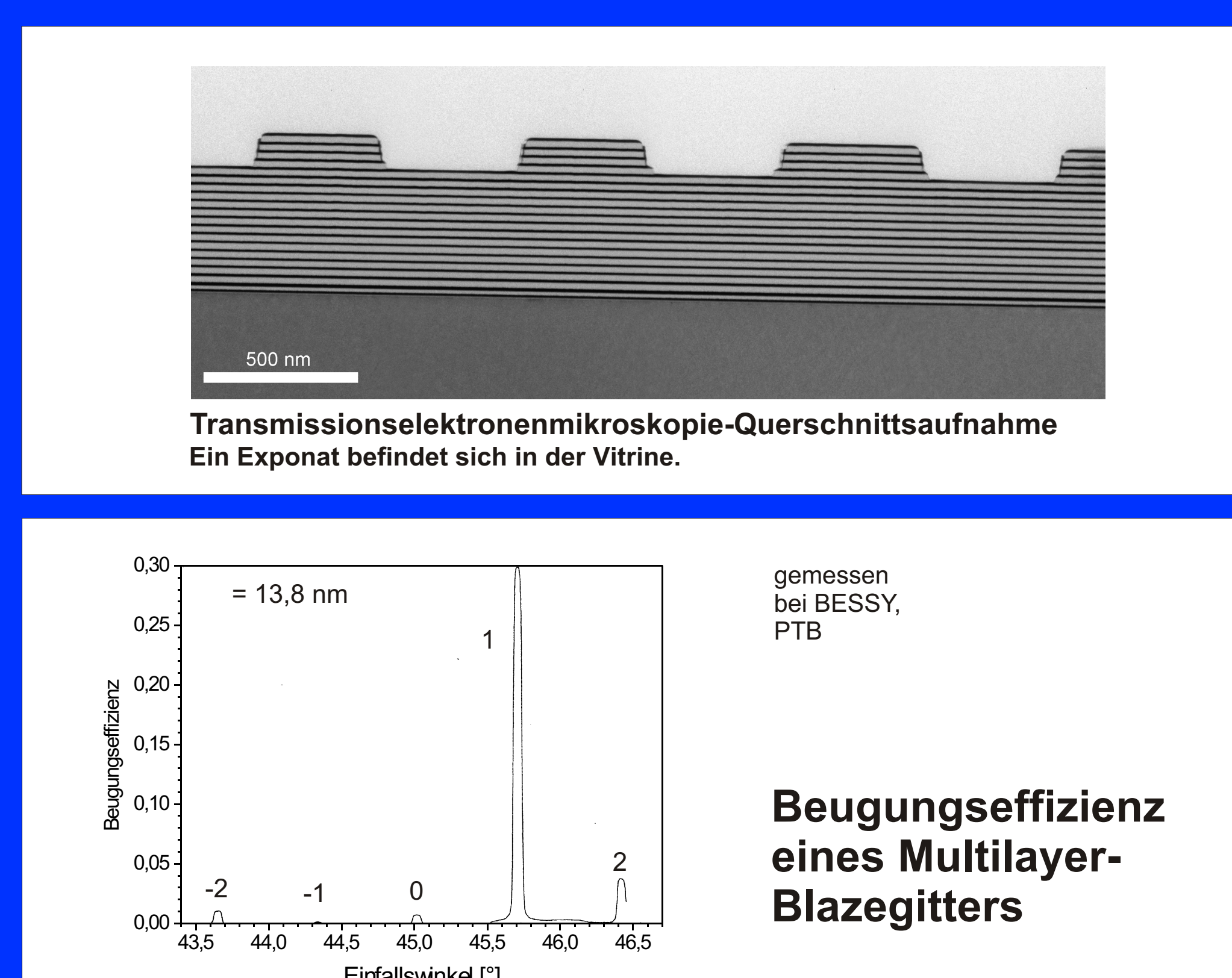
## Beschichtung mit Elektronenstrahlverdampfung, Ionenpolierung und in situ Reflektivitätskontrolle



## Fokussierende Röntgenoptik

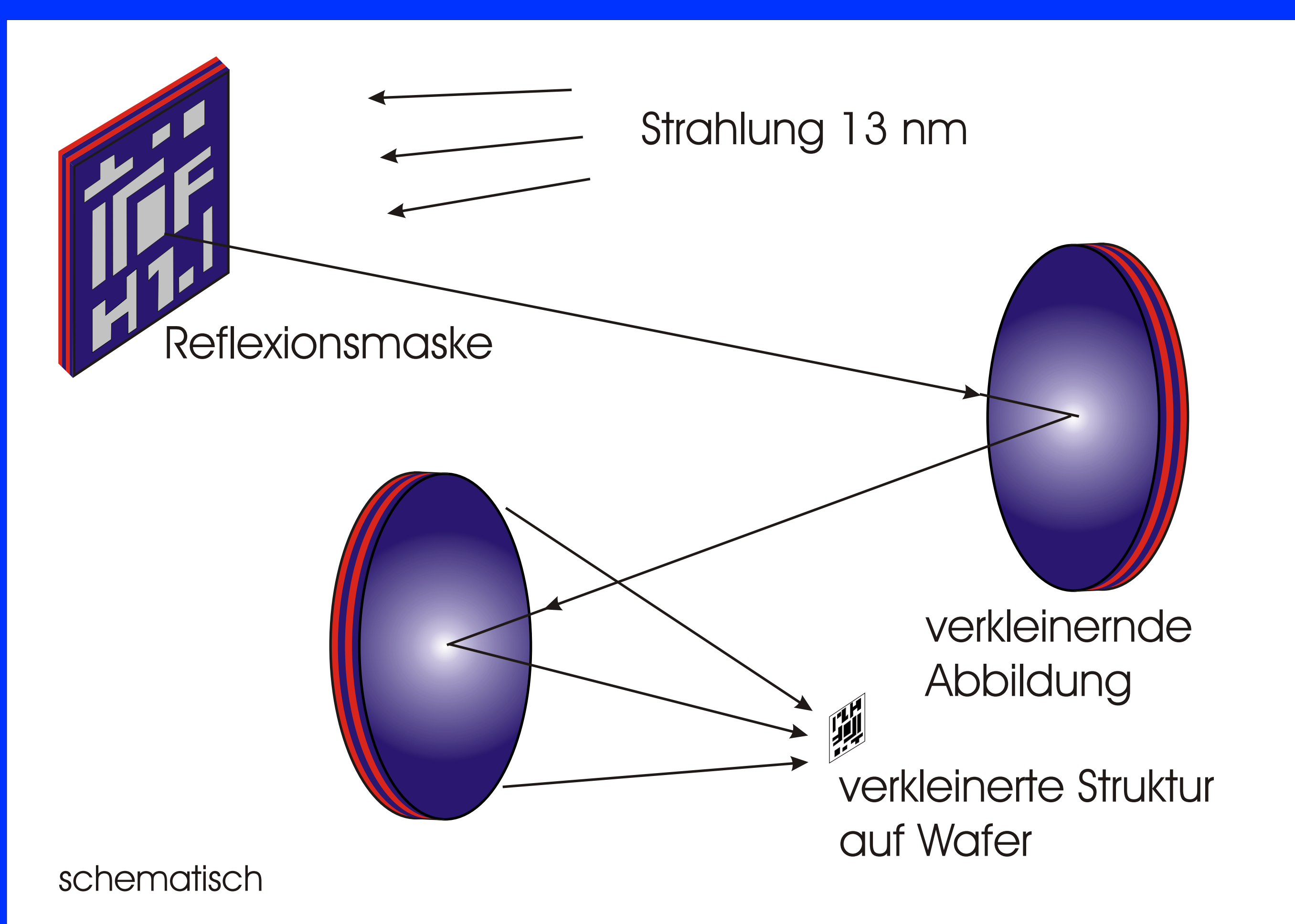


## Röntgen-Reflexionsgitter



**Ansprechpartner:**  
Prof. Dr. U. Heinzmann  
Tel.: +49-521-100-54 69  
uheinzmann@physik.uni-bielefeld.de  
Dr. U. Kleiberger  
Tel.: +49-521-100-54 58  
ukleiberger@physik.uni-bielefeld.de  
Dr. O. Wehmeyer  
Tel.: +49-521-100-31 51  
oehmeyer@physik.uni-bielefeld.de  
Dipl. Phys.  
T. Westervallbesoh  
Tel.: +49-521-100-31 69  
twesterv@post.uni-bielefeld.de  
Universität Bielefeld  
Fakultät für Physik - D4  
Universitätsstraße 25  
33615 Bielefeld  
FAX: +49-521-100-60 01

## Projektionslithographie EUVL



## Photoelektronenmikroskopie bei BESSY II

